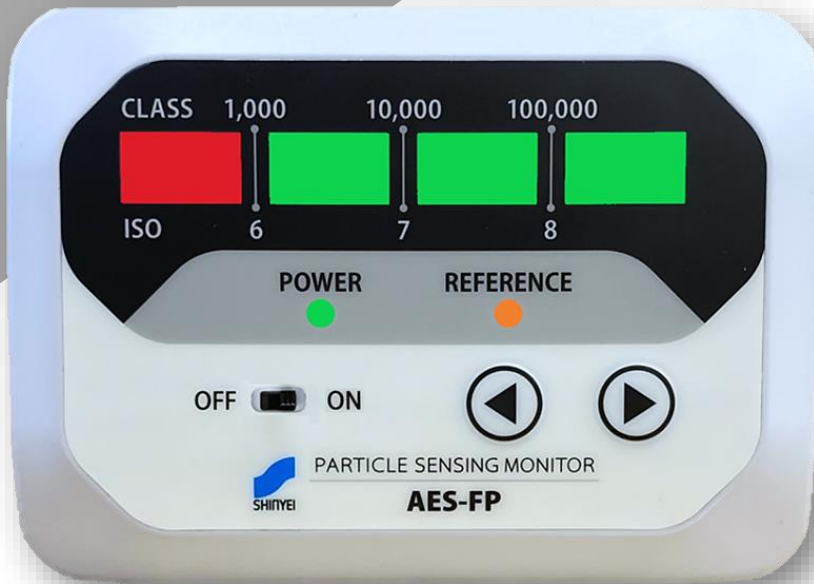


Particle Sensing monitor

AES-FP 시리즈



정밀부품의 제조공정과 청정도가 필요한 작업환경에서
청정도관리의 시각화를 저 Cost 로 실현!

특징 1

저가격대를 추구한 부유입자계측이 가능한 모니터

특징 2

청정도 CLASS 1,000~100,000 을 4 단계의 LED 로 표시

특징 3

0.3 μ m 과 5 μ m 이상의 입자수를 출력(참고치)

특징 4

용도에 맞춰서 출력사양이 다른 5 모델의 라인업

특징 5

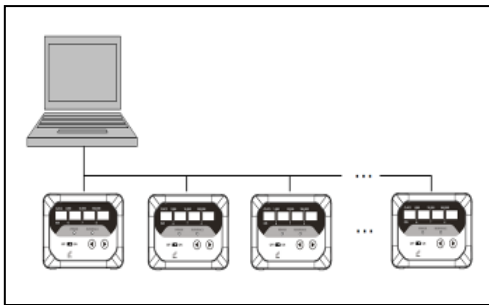
파티클센싱모니터 본체와 센서 Unit 의 분리탈착이 가능

■ 사양

		파티클 센싱 모니터				
		센서 Unit				
형명:AES-□□□		FPS	FPM-1	FPM-2	FPM-3	FPM-4
입자경	0.3um 이상 / 5.0um 이상(주 1)					
측정범위	Class1,000~ Class100,000 ※ Class1,000 은 참고치					
출력단위	pcs/m3, pcs/cp, pcs/L					
센서출력치	60 초 평균치(권장)					
데이터취득타이밍	1 초					
전원전압	12V					
소비전류	200mA	600mA				
동작온도	0~40°C					
보존온도	-20~60°C					
동작습도	30~80%rh					
보존습도	90%rh 이하					
능 도 출 력	디지털통신 (인터페이스)	○ RS485	—	○ Ethernet	—	○ Ethernet+Wi-Fi
	아날로그출력	—	—	—	0~5V	—
	LED 레벨표시	—	○	○	○	○
	Reference 표시	—	○	○	○	○
경보출력	— ○ ○ ○ ○ ○					
온습도계측(주 2)	— ○ ○ ○ ○ ○					
중량	약 65g		약 210g			

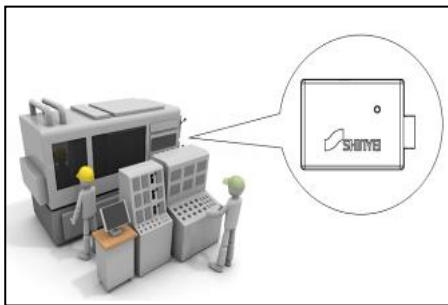
■ 용도 예

클린룸내에서의 다점 계측에



다점계측에 의한 일괄관리와 상시 모니터링에 따른 공장내 입자관리를 시각화. 청정화 대책에 공헌.

고객의 생산장치에의 내장장착



반도체 등 각종생산장치에 센서 Unit 을 조립, 부유입자의 발생을 감시하여 품질안정화 및 품질향상을 도모

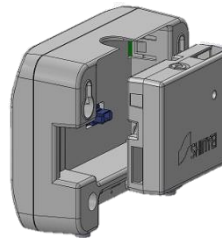
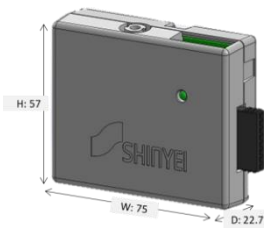
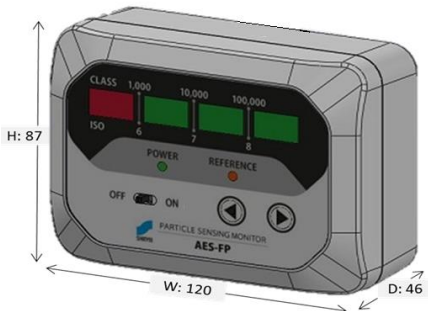
Data 센터 서버룸에



입자를 기피하는 장소에서의 상시 모니터링. 시각화로 청소빈도관리에 공헌.

■ 크기 · 탈착 이미지

※외관 · 사양은 변경될 가능성이 있습니다



단위 : mm

■ 문의처



서울특별시 마포구 마포대로 63 삼창빌딩 1351 호
 TEL : (02)703-2310 FAX : (02)703-2310
 www.e-hanju.co.kr ydmoon@e-hanju.co.kr



www.shinyei.co.jp